3) TW Laid-open Patent Application 510971

The object of the present invention is to effectively prevent the displacement of probe members toward an aligning direction, and to make the deformation of probe members independent to one another. The testing probe device (10) according to the present invention comprises: a mounting base (36) having a recess extending along an edge, elastic bodies (38, 86) configured at the recess for forming a portion protruding from the recess (42, 88), and a sheet (40) forming a plurality of wiring portions (46) on one side of a film (50. The sheet (40) is configured on the mounting base (36), making a periphery portion of the elastic bodies (38, 86) serve as a probe member (84), and providing a slit (54) at a location of the elastic bodies (38, 86) to isolate adjacent probe members (84).

第92137536號初審引證附件

中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號: 510971

[44]中華民國 91年 (2002) 11月 21日

發明

全9頁

[51] Int.CI 07: G01R1/00

H01L21/00

[54]名 稱: 測試用探針裝置

[21]申請案號: 088101858

[30]優先權: [31]11-17055

[22]申請日期:中華民國 88年 (1999) 02月08日

[32]1999/01/26 [33]日本

[72]發明人: 長谷川義榮

榮

日本

[71]申請人:

日本麥克隆尼股份有公司 日本[74]代理人: 陳燦暉(已歿) 先生

洪武雄 先生

1

[57]申請專利節圍:

- 1.一種測試用探針裝置,包含:具有至少一端緣及沿著該端緣延伸之凹陷部之安裝基座;在一部分突出於前述凹陷部之狀態下配置於前述門性體;及在電氣絕緣轉配之間,是有相互並列延伸之複數則以一個可具有相互並列延伸之前述時間,且在延伸於自前述凹陷之狀況,且在延伸於自前述凹陷之狀態,且在延伸於自前述凹陷之狀態,而且在延伸於自前述四陷之狀態,而且在延伸於自前述四陷之狀態,而且在延伸於自前述四陷之狀態,而且在延伸於自前述四陷之狀態,而且在延伸於相鄰配線部間之開緣。
- 2.如申請專利範圍第1項之測試用探針 裝置,其中,前述片狀元件係至少 於前述端緣或彈性體之配置處部分 反折,且位在前述開縫前方之前端 部及前述開縫後方之後端部安裝於 前述安裝基座上。
- 3.如申請專利範圍第1項之測試用探針

裝置,其中,前述彈性體之前述突 出部係形成弧面。

- 4.如申請專利範圍第2項之測試用探針 裝置,其中,前述彈性體之前述突 出部係形成弧面。
- 5.如申請專利範圍第1項之測試用探針 裝置,其中,還包括配置於前述安 裝基座且連接於前述配線部之驅動 用積體電路。
- 10. 6.如申請專利範圍第2項之測試用探針 裝置,其中,還包括配置於前述安 裝基座且連接於前述配線部之驅動 用積體電路。
- 7.如申請專利範圍第3項之測試用探針 15. 裝置,其中,還包括配置於前述安 裝基座且連接於前述配線部之驅動 用積體電路。
 - 8.如申請專利範圍第4項之測試用探針 裝置,其中,還包括配置於前述安 裝基座且連接於前述配線部之驅動

- 1713 -

5.

用積體電路。

- 9.如申請專利範圍第5項之測試用探針 裝置,其中,前述片狀元件具有連 接於前述積體電路且延伸於前述配 線部相反側之複數第2配線部。
- 10.如申請專利範圍第6項之測試用探 針裝置,其中,前述片狀元件具有 連接於前述積體電路且延伸於前述 配線部相反側之複數第2配線部。
- 11.如申請專利範圍第7項之測試用探 針裝置,其中,前述片狀元件具有 連接於前述積體電路且延伸於前述 配線部相反側之複數第2配線部。
- 12.如申請專利範圍第8項之測試用探 針裝置,其中,前述片狀元件具有 連接於前述積體電路且延伸於前述 配線部相反側之複數第2配線部。
- 13.如申請專利範圍第 4 項之測試用探 針裝置,其中,還包含具有連接於 前述積體電路之複數第3配線部之可 撓性印刷配線板。
- 14.如申請專利範圍第5項之測試用探 針裝置,其中,還包含具有連接於 前述積體電路之複數第3配線部之可 撓性印刷配線板。
- 15.如申請專利範圍第6項之測試用探 針裝置,其中,還包含具有連接於 前述積體電路之複數第3配線部之可 撓性印刷配線板。
- 16.如申請專利範圍第7項之測試用探 針裝置,其中,還包含具有連接於 前述積體電路之複數第3配線部之可 撓性印刷配線板。
- 17.如申請專利範圍第8項之測試用探 針裝置,其中,還包含具有連接於 前述積體電路之複數第3配線部之可 撓性印刷配線板。
- 18.如申請專利範圍第9項之測試用探 針裝置,其中,還包含具有連接於 前並積體電路之複數第3配線部之可

撓性印刷配線板。

- 19.如申請專利範圍第10項試用探針裝置,其中,還包含具有連接於前述 積體電路之複數第3配線部之可撓性 印刷配線板。
- 20.如申請專利範圍第11項測試用探針 裝置,其中,還包含具有連接於前 並積體電路之複數第3配線部之可撓 性印刷配線板。
- 10. 21.如申請專利範圍第12項測試用探針 裝置,其中,還包含具有連接於前 逃積體電路之複數第3配線部之可撓 性印刷配線板。
- 22.如申請專利範圍第1至第21項中任 15. 一項之測試用探針裝置,其中,前 並彈性體於前述突出部具有連通於 各開縫之開縫。
- 23.如申請專利範圍第1至第21項中任 一項之測試用探針裝置,其中,還 20. 包含中央具有開口之基座板,而前 並安裝基座則在將前並彈性體之配 置位置突出於前述開口狀態下組裝 於前述基座板上。
- 24.如申請專利範圍第8項之測試用探 25. 針裝置,其中,將前述安裝基座組 裝於前述基座板之組裝機構具備有 在將前端部突出於前述開口狀態下 組裝於前述基座板之Z基座;及可 朝前述基座板厚度方向移動地組裝 30. 於前述Z基座前端部之活動片。

圖式簡單說明:

第1圖為顯示測試用探針裝置一 實施例之俯視圖。

第2圖為沿第1圖2-2線之剖視35.圖,係將測試用探針裝置與檢查裝置之檢查台同時顯示之剖視圖。

第3圖為顯示第1圖所示測試用探針裝置中所用之探測塊前端部之一實施例斜視圖。

40. 第4圖為探測塊之俯視圖。

5

第 5 圖為沿第 4 圖 5-5 線之剖視 圖。

第6圖為第5圖所示探測塊之左側 視圖。

第7圖為探測塊之放大剖視圖。

第8圖係為片狀元件製造方法的說明圖、(A)為形成開縫之前的說明圖、(B)為形成開縫之後的說明圖、(C)則為開縫附近之放大圖。

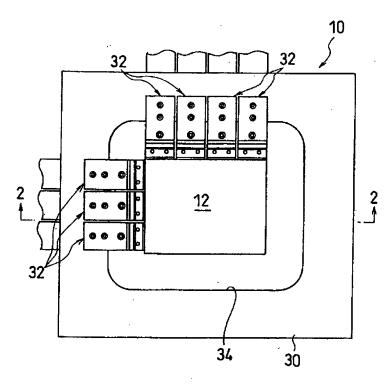
第9圖為顯示將探針構件按壓於

第9 圖為顯示將保針稱什按壓於 液晶基板時探針構件之變形狀態放大 圖。

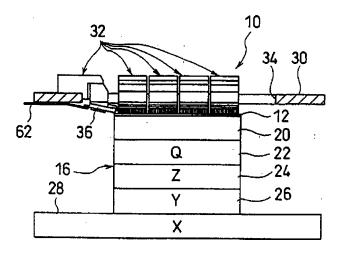
第 10 圖為顯示彈性體及凹陷部之 . 其他實施例圖。

第11 圖為顯示於探針構件形成突 出電極實施例之剖視圖。

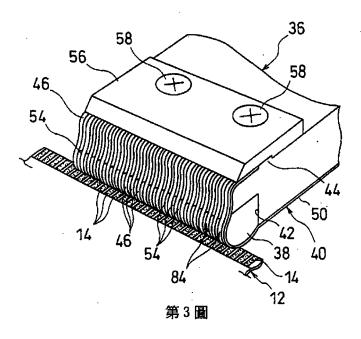
第12圖為顯示於彈性體形成開縫 之實施例剖視圖。



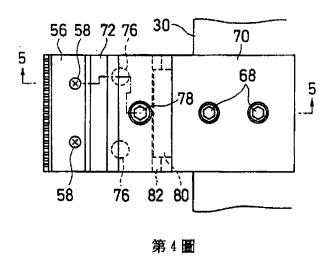
第1圖

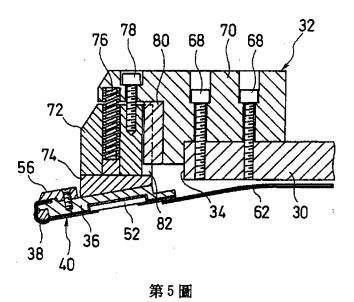


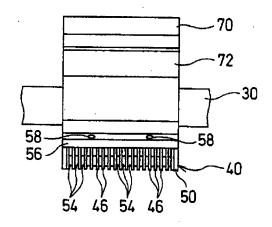
第2圖



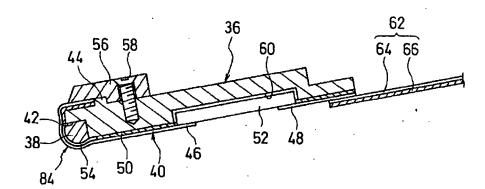
- 1716 -



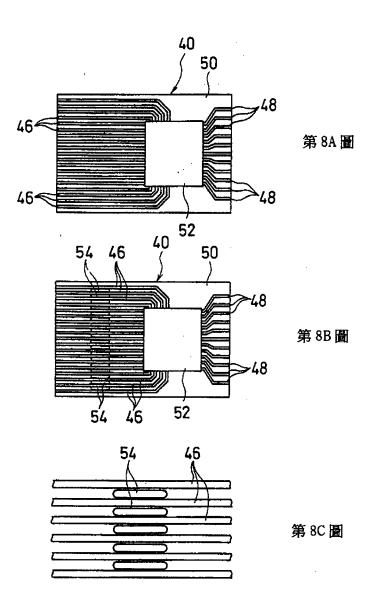


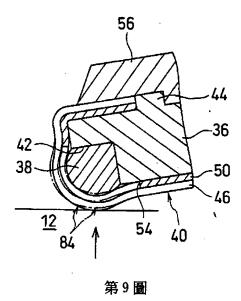


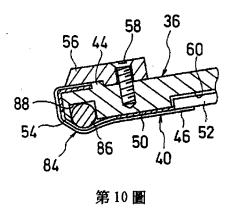
第6圖

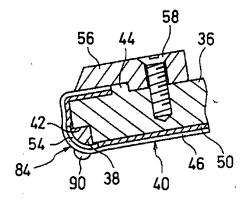


第7圖

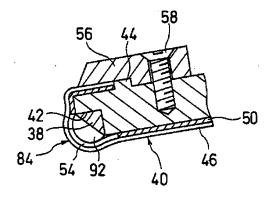








第11圖



第12圖